

低炭素関連装置 運用細目

装置名	表面安定化成膜装置
設置場所	早稲田大学 各務記念材料技術研究所 42-3号館
装置管理者	川原田 洋
取扱責任者	川原田 洋

1 パワーユーザの必要要件、権限範囲

- (1) パワーユーザとは、装置の停止、立ち上げ、一般管理（記録、備品準備など）に関して取扱い責任者と同等の技量を持ち、かつ、精密装置の操作に適した感性、几帳面さを持つ者である。
- (2) パワーユーザは、各研究室で1名決める。パワーユーザを決めることができない研究室は、他研究室のパワーユーザが兼務しても可（事前に依頼すること）。
- (3) パワーユーザは、取扱責任者の講習を受け、合格した者とする。また、定期的な講習を通して、技量の維持向上を図る。
- (4) パワーユーザは、一般利用者の補助を行う。また、ビーム源交換／フィラメント交換に関してはパワーユーザのみが行い、一般利用者を行わない。

2 一般利用者の定義について

- (1) 一般利用者はパワーユーザから講習をうけ、合格したのち取扱い責任者が承認したものとし、本定義に従う一般利用者のみ当該装置を利用可とする。
- (2) 学外からの利用依頼に関する各種事務手続きは、まずナノ理工学研究機構で対応する。

3 利用制限、禁止行為について

- (1) 本装置による一般開放の操作は、各種ビーム照射およびヒーターによる加熱、RHEEDによる表面観察とする。